

⑫ 公開実用新案公報(U) 平3-38636

⑥Int.Cl.<sup>5</sup>

H 01 L 21/68

識別記号

A

庁内整理番号

7454-5F

⑬公開 平成3年(1991)4月15日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

⑭考案の名称 基板処理装置

⑮実 願 平1-99460

⑯出 願 平1(1989)8月25日

⑰考 案 者 大 神 信 敏 京都府京都市伏見区羽束師古川町322番地 大日本スクリーン製造株式会社洛西工場内

⑱考 案 者 杉 本 憲 司 京都府京都市伏見区羽束師古川町322番地 大日本スクリーン製造株式会社洛西工場内

⑲出 願 人 大日本スクリーン製造株式会社 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1

⑳代 理 人 弁理士 北 谷 寿一

㉑実用新案登録請求の範囲

複数種の基板処理ユニットと、各基板処理ユニットへ基板を給排する自走式基板搬送手段とを具備して成る基板処理装置において、

少なくとも1以上の基板処理ユニットに定置式基板移載手段を付設配置し、定置式基板移載手段は、当該処理ユニットの処理完了後、自走式基板搬送手段が当該処理ユニットに到着していない時、自走式基板搬送手段が受取り可能になるまで、当該処理ユニットによる処理済み基板をパッ

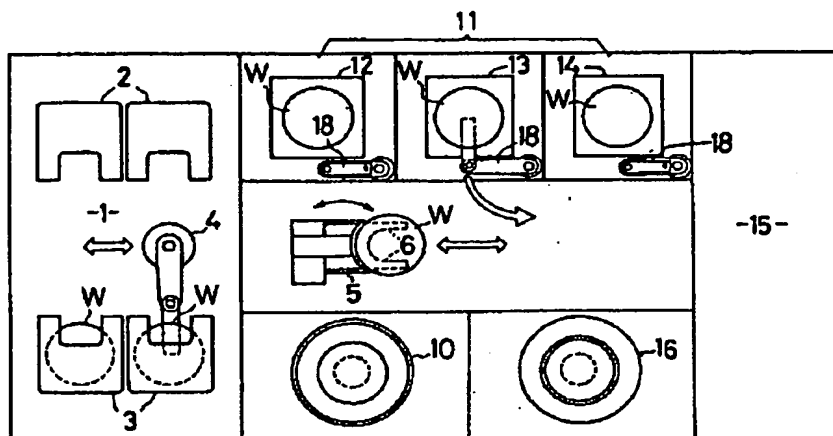
フアスペースへ停留させるように構成したことを特徴とする基板処理装置。

図面の簡単な説明

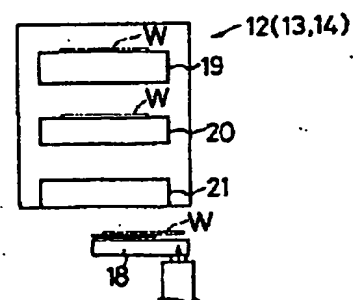
第1図は本考案に係る基板処理装置の模式的平面図、第2図は熱処理部を構成する各ユニットの1例を示す正面図、第3図は従来例の模式的平面図である。

5…自走式基板搬送手段、10～16…基板処理ユニット、18…定置式基板移載手段。

第1図



第2図



# 公開実用平成 3-38636

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U) 平3-38636

⑬ Int.Cl.<sup>3</sup>

H 01 L 21/68

識別記号

A

庁内整理番号

7454-5F

⑭ 公開 平成 3 年(1991) 4 月15日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

⑮ 考案の名称 基板処理装置

⑯ 実 願 平1-99460

⑰ 出 願 平 1 (1989) 8 月25日

⑱ 考 案 者 大 神 信 敏 京都府京都市伏見区羽束師古川町322番地 大日本スクリーン製造株式会社洛西工場内

⑲ 考 案 者 杉 本 憲 司 京都府京都市伏見区羽束師古川町322番地 大日本スクリーン製造株式会社洛西工場内

⑳ 出 願 人 大日本スクリーン製造株式会社 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る 4 丁目天神北町 1 番地の 1

㉑ 代 理 人 弁理士 北 谷 寿 一